

2022年12月1日

各 位

会 社 名 レーザーテック株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡林 理  
(コード：6920 東証プライム市場)  
発表担当 執行役員 経営企画部長 三澤 祐太郎  
(TEL.045-478-7111)

## 新製品 高感度ウェハエッジ検査装置 CIEL シリーズを発表

従来機では対応できなかったウェハエッジ・ベベル部の欠陥を高精度に分類

この度レーザーテックは、高感度ウェハエッジ検査装置 CIEL シリーズを製品化致しました。

### 【説明】

半導体デバイスの微細化や高積層化に伴い、ウェハエッジを発生源とする欠陥種が増え検出サイズも小さくなっており、この多様な欠陥の中から、歩留まりを低下させる欠陥のみを検出・分類する装置が求められています。

CIEL は、EZ300 の光学系を一新させ、独自光学系による高感度・高スループット検査を実現しました。また、ディープラーニング技術を用いた高精度な欠陥分類と、独自光学系の 3D 機能によって高さ・深さ情報を含む高解像度画像の取得を可能とし、検出すべき欠陥を特定する機能を充実させました。

当社では今後も、先端半導体プロセスにおけるニーズにお応えし、半導体製造プロセスの品質改善、歩留まり向上に向けて貢献してまいります。

### 【特長】

- 従来検出・分類できなかった微小欠陥の特定が可能
- 高スループットモードを搭載。運用用途に応じて対応可能
- 3D 測定機能

### 【用途】

- 半導体デバイス工程におけるウェハエッジ・ベベルのプロセスモニタリング・フィードバック
- 歩留まりに直結する欠陥の抽出
- 3D 測定によるプロセス改善



CIEL シリーズ

**【本装置のお問い合わせ先】**

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第2ソリューションセールス部 上菌 秀正

TEL : 045-478-7337

E-mail : hidemasa.uezono@lasertec.co.jp

以 上